

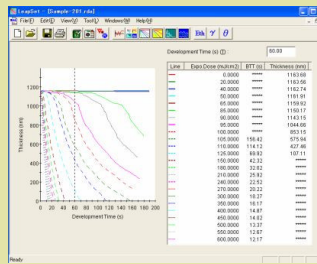
レジスト現像アナライザ RDAシリーズ

RDA-760/RDA-790/RDA-800/RDA-Qz3

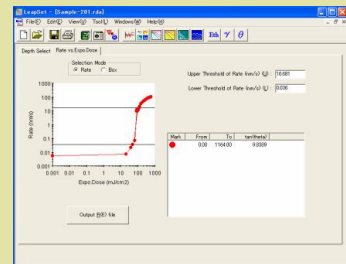
レジスト現像アナライザは、最新鋭の18チャンネル現像速度解析評価装置です。このシステムを用いることにより、フォトリソの現像速度測定、コントラストカーブ、感度の算出などの現像特性解析が迅速に行えます。また、リソグラフィ・シミュレータに必要なレジスト・モデリング・パラメータを正確に決定することができます。

主な機能

- 現像速度の測定・解析
Si基板、多層膜基板、Al基板、ARC上のレジストに対応
- 現像特性解析
 γ 値、Eth、ディスクリミネーションカーブの測定、現像コントラスト($\tan \theta$)の算出
- 正確なモデリングパラメータの決定
現像パラメータ、拡散長、表面難溶化パラメータの決定
- データテーブルの作成とシミュレータへのデータ転送
- 現像液の自動供給、排水システム
- ウエーハの自動インサート、基板サイズは4~8インチ(12インチ対応可)



【残膜曲線画面】



【ディスクリミネーションカーブ】

LINEUP

RDA-760



レジスタアナライザ

特徴

1チャンネルモニターを標準とする樹脂の溶解速度測定・評価装置
樹脂の品質管理に最適

RDA-790



レジスト現像アナライザ
レンズ固定タイプ

特徴

18チャンネルモニターの標準機
モニター波長は470nm(薄膜用)と950nm(厚膜用)をDualで搭載

RDA-800



レジスト現像アナライザ
レンズ同期タイプ

特徴

レンズとサンプル基板が同期して動き、現像液に入った瞬間から解析可能
ArFレジストのようなRmaxが速いサンプル評価に最適
モニター波長は470nm(薄膜用)と950nm(厚膜用)をDualで搭載

RDA-Qz3



QCM対応レジスト現像アナライザ

特徴

QCM(クォーツ・マイクロバラン)法を用い、現像するレジスト膜の質量変化を測定する現像アナライザ
現像中のレジストの膨潤挙動も解析可能

リソテックジャパンでは、常時ご評価頂くためのデモ装置を準備しております。ご来訪の上、ご評価頂くか、サンプルを送付して頂ければ、各装置評価用のデータ取得を行いますので、お気軽にお申し付けください。また、特殊な仕様についても検討いたしますのでご相談ください。

LTJ リソテックジャパン株式会社
Litho Tech Japan

〒332-0034 埼玉県川口市並木2-6-6-201
TEL 048-258-6775 FAX 048-258-6673
E-mail: tech-support@ltj.co.jp
http://www.ltj.co.jp

リソテックジャパンはリソグラフィの未来を見つめ続けています